

ご来場ありがとうございました

SEMICON[®]
JAPAN
HYBRID

CKDはプロセス制御の
未来を共に拓きます

2021.12.15(水) ≧ 17(金)

東京ビッグサイト

CKD
東4ホール
4337



Chemical

低パーティクル・高精度制御で微細化プロセスに貢献

■薬液用マニュアルバルブ
MMD*3RNシリーズ



■パイロットレギュレータ
PMP002シリーズ



■電動ニードル
バルブ
MNVシリーズ



Gas

高い信頼性で最先端プロセスに対応

■集積化ガス供給システム
IAGDシリーズ



■プロセスガス用レギュレータ
PGMシリーズ



■高温・高耐久ガスバルブ
AGDシリーズ



Vacuum

オリジナル技術でプロセスの安定化を実現

- 真空圧力制御システム IAVBシリーズ



- 真空圧比例制御システム VEC-Rシリーズ



Factory Automation

カーボンニュートラルの実現に貢献

- 高耐久機器 HPシリーズ

HP
HIGH PRODUCTIVITY



- 電動アクチュエータ (低発塵仕様) ECSシリーズ



- 画像処理ビジュアルプログラミングツール

Facilea



- 超薄型ダイレクトドライブモータ ND-uシリーズ



ホームページに
特設サイト公開中 >>>



Fine System Components

半導体最先端プロセスを支える

CKDのファインシステム機器

